

参考

統合システム装置検索(分析部門(すずかけ台))

【所在キャンパス】に
「*すずかけ(*は半角)」を入力して
装置を絞り込んでみる

検索	検索	検索	検索	検索	検索	検索	検索
<input type="checkbox"/>	Inquiry Counter-Design and Manufacturing...	Inquiry Counter-DM_S-OFC			Suzukakedai/すずかけ台	R3 Bldg./R3高層棟・低層棟	大森 翔, 長峯 靖之, 石山 修, 小屋畑 洋平, 杉原 輝哉, 村
<input type="checkbox"/>	Inquiry Counter-Design and Manufacturing...	Inquiry Counter-DM_S-OFC			Ookayama/大岡山	Ishikawadai Bldg. 5/石川台5号館	長峯 靖之, 吉井 昌一, 吉沢 誠, 井上 亨, 楠田 昌之, 小出
<input type="checkbox"/>	Inquiry Counter-Materials Analysis Divis...	Inquiry Counter-MA_S-OFC			Suzukakedai/すずかけ台	R1 Bldg./R1棟	堀 克明, 秋本 由佳, 小泉 公人, 庄司 大, 須田 勝美, 中村

次ページの表を参考に、【設備表示名】の一部を入力して検索してみる
例: 多角度光散乱システム・・・「light」と入力

次ページの表を参考に、【型番】を入力して検索してみる
例: 質量分析装置 ESI-TOF-MS・・・「microTOF II」と入力
「micro」だけでもOK

大学連携研究設備ネットワークでの設備名		設備表示名	設備名称	カテゴリ	メーカー	型番	所在キャンパス	所在建物	設備担当者	
有機元素分析装置	有機元素分析装置	有機元素分析装置 CHNコーダー JM10	Elemental Analyzer-1-Materi	JM10-MA-OFC	636-JSIA040701:有機微量元素分析装置	Jscience	JM10	Suzukakedai/す	R1 Bldg./R1棟	原 智恵子, 富田 香苗
		有機元素分析装置 vario EL cube	Elemental Analyzer-2-Materi	varioELcube-MA-OFC	636-JSIA040701:有機微量元素分析装置	Elementar	varioELcube	Suzukakedai/す	R1 Bldg./R1棟	原 智恵子, 富田 香苗
		有機元素分析装置 vario Micro cube	Elemental Analyzer-3-Materi	variomicrocube-MA-OFC	636-JSIA040701:有機微量元素分析装置	Elementar	variomicrocube	Suzukakedai/す	R1 Bldg./R1棟	原 智恵子, 富田 香苗
		-	Ion Chromatography System	ICS-1100-MA-OFC	636-JSIA040403:イオンクロマトグラフ	Thermo Fisher Scientific	ICS-1100	Suzukakedai/す	R1 Bldg./R1棟	原 智恵子, 富田 香苗
		-	Halogen sulfur element analyz	HSU-20-MA-OFC	636-JSIA040701:有機微量元素分析装置	Yanaco	HSU-20	Suzukakedai/す	R1 Bldg./R1棟	原 智恵子, 富田 香苗
	天びん	-	ultramicrobalance-1-Materia	MSA2-MA-OFC	636-JSIA040801:上記以外のラボ用分析機器、部品・付属品	Sartorius	MSA2	Suzukakedai/す	R1 Bldg./R1棟	原 智恵子, 富田 香苗
		-	ultramicrobalance-2-Materia	SE2-MA-OFC	636-JSIA040801:上記以外のラボ用分析機器、部品・付属品	Sartorius	SE2	Suzukakedai/す	R1 Bldg./R1棟	原 智恵子, 富田 香苗
		-	microbalance-1-Materials An	ME5-1-MA-OFC	636-JSIA040801:上記以外のラボ用分析機器、部品・付属品	Sartorius	ME5	Suzukakedai/す	R1 Bldg./R1棟	原 智恵子, 富田 香苗
		-	microbalance-2-Materials An	ME5-2-MA-OFC	636-JSIA040801:上記以外のラボ用分析機器、部品・付属品	Sartorius	ME5	Suzukakedai/す	R1 Bldg./R1棟	原 智恵子, 富田 香苗
		-	microbalance-3-Materials An	XP-1-MA-OFC	636-JSIA040801:上記以外のラボ用分析機器、部品・付属品	Mettler-Toledo	XP-1	Suzukakedai/す	R1 Bldg./R1棟	原 智恵子, 富田 香苗
	グローブボックス	-	glovebox-Materials Analysis	Type G-MA-OFC	636-JSIA030204:グローブボックス	SANPLATEC	Type G	Suzukakedai/す	R1 Bldg./R1棟	原 智恵子, 富田 香苗
	無機元素分析装置	ICP質量分析装置 (パーキンエルマージャパン・ELAN DRC-es)	Inductively Coupled Plasma	ICP-MS ELAN-DRC-es-MA-OFC	636-JSIA040307:上記以外の質量分析装置	PerkinElmer	ICP-MS ELAN-DRC-es	Suzukakedai/す	R1 Bldg./R1棟	中村 紳兵
		ICP発光分光分析装置 (島津製作所・ICPS-8100)	Inductively Coupled Plasma	ICPS-8100-MA-OFC	636-JSIA040206:発光分光分析装置	Shimadzu	ICPS-8100	Suzukakedai/す	R1 Bldg./R1棟	中村 紳兵
蛍光X線分析装置 (Bruker・S2LANGER)		Energy dispersive X-ray spec	EDXRF S2RANGER LET-MA-OFC	636-JSIA040302:蛍光X線分析装置	Bruker AXS	EDXRF S2RANGER LET	Suzukakedai/す	R1 Bldg./R1棟	中村 紳兵	
質量分析装置	ESI-TOF-MS (ブルカー・micrOTOF II)	Electrospray ionization - Tim	micrOTOF II -MA-OFC	636-JSIA040307:上記以外の質量分析装置	Bruker Daltonics	micrOTOF II	Suzukakedai/す	R1 Bldg./R1棟	小泉 公人, 原 智恵子	
	MALDI-TOF-MS (Bruker製 ultrafleXtreme)	Matrix Assisted Laser Desorp	UltrafleXtreme-MA-OFC	636-JSIA040307:上記以外の質量分析装置	Bruker Daltonics	UltrafleXtreme	Suzukakedai/す	R1 Bldg./R1棟	小泉 公人	
	二重収束型質量分析装置 (日本電子・JMS-700MStation)	Double focusing mass spectre	JMS-700-MA-OFC	636-JSIA040307:上記以外の質量分析装置	JEOL	JMS-700	Suzukakedai/す	R1 Bldg./R1棟	小泉 公人	
構造解析装置	試料水平型多目的X線回折装置 (リガク・Ultima IV)	Powder X-ray Diffractometer	Ultima IV-MA-OFC	636-JSIA040301:X線回折装置	Rigaku	Ultima IV	Suzukakedai/す	R1 Bldg./R1棟	須田 勝美	
	X線回折-示差走査熱量同時測定装置 (リガク・X-ray DSC)	X-ray DSC (XRD-DSC)-Mate	XRD-DSC-MA-OFC	636-JSIA040301:X線回折装置	Rigaku	XRD-DSC	Suzukakedai/す	R1 Bldg./R1棟	須田 勝美	

電子顕微鏡	電子顕微鏡	透過電子顕微鏡 (日本電子(株)・JEM-2100F)	Field Emission Transmission	JEM-2100F-MA-OFC	636-JSIA040309:透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2100F	Suzukakedai/す	J1 Bldg./J1棟	秋本 由佳, 庄司 大
		透過電子顕微鏡 (日本電子(株)・JEM-1400)	Transmission Electron Micros	JEM-1400-MA-OFC	636-JSIA040309:透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-1400	Suzukakedai/す	R1 Annex B/R	秋本 由佳
		FIB (日本電子(株)・JIB-4500型)	MultiBeam System-Materials	JIB-4500-MA-OFC	636-JSIA040316:上記以外の電磁気分析装置	JEOL	JIB-4500	Suzukakedai/す	J1 Bldg./J1棟	庄司 大
		走査電子顕微鏡 (日立ハイテクノロジーズ・S-5500型)	Field Emission Scanning Elec	S-5500-MA-OFC	636-JSIA040310:走査電子顕微鏡	Hitachi High-Technologies	S-5500	Suzukakedai/す	R1 Annex B/R	秋本 由佳
		走査電子顕微鏡 (日本電子(株)・JSM-6610LA型)	Scanning Electron Microscop	JSM-6610LA-MA-OFC	636-JSIA040310:走査電子顕微鏡	JEOL	JSM-6610LA	Suzukakedai/す	R1 Bldg./R1棟	秋本 由佳
		走査電子顕微鏡 (日本電子(株)・JSM-IT100)	Scanning Electron Microscop	JSM-IT100-MA-OFC	636-JSIA040310:走査電子顕微鏡	JEOL	JSM-IT100	Suzukakedai/す	J1 Bldg./J1棟	庄司 大
	電子顕微鏡 前処理装置群	ウルトラマイクローム (UC6/FC6)	Ultramicrotome-Materials An	UC6/FC6-MA-OFC	636-JSIA040316:上記以外の電磁気分析装置	Leica Microsystems	UC6/FC6	Suzukakedai/す	R1 Annex B/R	秋本 由佳
		精密イオンポリッシングシステム (Gatan model691)	Precision Ion Polishing Syste	Model.691-MA-OFC	636-JSIA040316:上記以外の電磁気分析装置	Gatan	Model.691	Suzukakedai/す	J1 Bldg./J1棟	庄司 大
		-	Dimple Grinder-Materials Ana	Model.656-MA-OFC	636-JSIA040316:上記以外の電磁気分析装置	Gatan	Model.656	Suzukakedai/す	J1 Bldg./J1棟	庄司 大
		-	Disc Grinder-Materials Analy	Model.623-MA-OFC	636-JSIA040316:上記以外の電磁気分析装置	Gatan	Model.623	Suzukakedai/す	J1 Bldg./J1棟	庄司 大
		-	Precision cutting-Materials A	IsoMet LS-MA-OFC	636-JSIA040316:上記以外の電磁気分析装置	Buehler	IsoMet LS	Suzukakedai/す	J1 Bldg./J1棟	庄司 大
		-	Vacuum Evaporator-2-Mater	JEE-420T-MA-OFC	636-JSIA040316:上記以外の電磁気分析装置	JEOL	JEE-420T	Suzukakedai/す	J1 Bldg./J1棟	庄司 大
		-	Vacuum Evaporator-1-Mater	JEE-400-MA-OFC	636-JSIA040316:上記以外の電磁気分析装置	JEOL	JEE-400	Suzukakedai/す	R1 Annex B/R	秋本 由佳
		-	Carbon Coater-2-Materials A	CADE-E-MA-OFC	636-JSIA040316:上記以外の電磁気分析装置	Meiwafosis	CADE-E	Suzukakedai/す	J1 Bldg./J1棟	庄司 大
		-	Ion Coater-Materials Analysis	IB-3-MA-OFC	636-JSIA040316:上記以外の電磁気分析装置	Eiko	IB-3	Suzukakedai/す	J1 Bldg./J1棟	庄司 大
		-	Magnetron sputtering equipm	MSP-1S-MA-OFC	636-JSIA040316:上記以外の電磁気分析装置	VACUUM DEVICE	MSP-1S	Suzukakedai/す	R1 Bldg./R1棟	秋本 由佳
		-	Ion Sputter Coater-Materials	MC1000-MA-OFC	636-JSIA040316:上記以外の電磁気分析装置	Hitachi High-Technologies	MC1000	Suzukakedai/す	R1 Annex B/R	秋本 由佳

熱分析装置	熱分析装置	TG-DTA (島津製作所・DTG-60)	Thermogravimetry/differentia	DTG-60-MA-OFC	636-JSIA040601:熱分析装置	Shimadzu	DTG-60	Suzukakedai/す	R1 Bldg./R1棟	須田 勝美
		示差熱天秤-光イオン化質量分析同時測定システム (リガク・Thermo Mass Photo)	Thermo mass TG-DTA/mass	ThermoMass TSR-MA-OFC	636-JSIA040601:熱分析装置	Rigaku	ThermoMass TSR	Suzukakedai/す	R1 Bldg./R1棟	須田 勝美
	天びん	-	Micro Balance-Materials Ana	ME36S-MA-OFC	636-JSIA040801:上記以外のラボ用分析機器、部品・付属品	Sartorius	ME36S	Suzukakedai/す	R1 Bldg./R1棟	須田 勝美
その他	サイズ排除クロマトグラフィー (東ソー HLC-8420GPC)	Size Exclusion Chromatograp	HLC-8420GPC-MA-OFC	636-JSIA040706:粒径・粒度分布測定装置	TOSOH	HLC-8420GPC	Suzukakedai/す	R1 Bldg./R1棟	富田 香苗	
	多角度光散乱検出器システム (Wyatt Technology・DAWN + Optilab + DynaPro)	light scattering system-Mate	DAWN HELEOS II-MA-OFC	636-JSIA040706:粒径・粒度分布測定装置	Wyatt Technology	DAWN HELEOS II・Optilab T-rEX・Dynapro	Suzukakedai/す	R1 Bldg./R1棟	富田 香苗	
	時間分解吸収・発光スペクトル解析システム (浜松ホトニクス(株)・C7700-ABS-N)	Time Resolved Absorption Sp	TRASAS-MA-OFC	636-JSIA040210:上記以外の2次量子光分析装置	HAMAMATSU PHOTONICS	TRASAS	Suzukakedai/す	J1 Bldg./J1棟	庄司 大	
	分光エリプソメーター (日本分光・ELC300)	Spectroscopic Ellipsometer-N	ELC300-MA-OFC	636-JSIA040213:上記以外の光分析装置	JASCO	ELC300	Suzukakedai/す	J1 Bldg./J1棟	庄司 大	